(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号 特表2001-503100 (P2001-503100A)

(43)公表日 平成13年3月6日(2001.3.6)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
C09K 3/18	104	C 0 9 K 3/18	104
C 0 3 C 17/34		C 0 3 C 17/34	Α
# C 0 9 D 183/00		C 0 9 D 183/00	

審査請求 有 予備審査請求 有 (全 18 頁)

		眷 宜 前	有
(21)出願番号	特願平10-539439	(71)出願人	日本板硝子株式会社
(86) (22)出顧日	平成10年3月11日(1998.3.11)		大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号
(85)翻訳文提出日	平成11年9月1日(1999.9.1)	(72)発明者	山本 博章
(86)国際出願番号	PCT/JP98/01001		大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号
(87)国際公開番号	WO98/40323		日本板硝子株式会社内
(87)国際公開日	平成10年9月17日(1998.9.17)	(72)発明者	小林 浩明
(31)優先権主張番号	9/56342		大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号
(32)優先日	平成9年3月11日(1997.3.11)		日本板硝子株式会社内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	寺西 豊幸
			大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号
			日本板硝子株式会社内
		(74)代理人	弁理士 小山 有

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 表面処理された基材および基材の表面処理方法

(57)【要約】

下地膜を介して、基材と撥水膜とが強固に結びつき、しかも、低い臨界傾斜角、優れた耐久性を有し、緻密性が高い基材を得るため、基材表面に、クロロシリル基を分子内に有する物質をアルコール系溶媒に溶解して反応させた下地処理液を乾燥せしめてなる下地膜を形成し、この下地膜の上に撥水層または撥油層等の表面層が形成され、且つ表面粗さ(Ra)が0.5 nm以下とした。

【特許請求の範囲】

- 1. ガラス、セラミックス、プラスチック或いは金属等の基材表面に、クロロシリル基を分子内に有する物質をアルコール系溶媒に溶解して反応させた下地処理液を乾燥せしめてなる下地膜が形成され、この下地膜の上に撥水層または撥油層等の表面層が形成され、且つ当該表面層の表面粗さ(Ra)が 0.5 nm以下であることを特徴とする表面処理された基材。
- 2. 請求項1に記載の表面処理された基材において、前記クロロシリル基を分子内に有する物質の下地処理液中の濃度は0.00wt%以上3.0wt%以下であることを特徴とする表面処理された基材。
- 3. 請求項1に記載の表面処理された基材において、前記クロロシリル基を分子内に有する物質の下地処理液中の濃度は0.03wt%以上1.0wt%以下であることを特徴とする表面処理された基材。
- 4. 請求項1乃至請求項3に記載の下地処理液において、前記クロロシリル基を分子内に有する物質は、SiCl4、SiHCl3 またはSiH2 Cl2 のうちの少なくとも1種であることを特徴とする表面処理された基材。
- 5. 請求項1乃至請求項4に記載の表面処理された基材において、前記下地膜が形成される基材の表面は研磨洗浄により表面粗さ(Ra)が0.5~3.0 nm程度まで粗されていることを特徴とする表面処理された基材。
- 6. クロロシリル基を分子内に有する物質をアルコール系溶媒に溶解して反応 させた下地処理液をガラス、セラミックス、プラスチック或いは金属等の基材表 面に塗布し、この塗布された下地処理液を乾燥せしめた後に焼成することなく撥 水または撥油処理等の表面処理を行うようにしたことを特徴とする基材の表面処 理方法。

【発明の詳細な説明】

表面処理された基材および基材の表面処理方法

技術分野

本発明はガラス、セラミックス、プラスチック或いは金属等の基材表面に下地膜を介して撥水膜等を形成した表面処理された基材と、基材の表面処理方法に関する。

背景技術

ガラス等の基材表面に撥水性被膜を形成した先行技術として、特公平4-20781号公報、特開平5-86353号公報、特開平5-161844号公報及び特開平2-311332号公報、特許第2,525,536号公報に開示されるものがある。

特公平4-20781号公報には、基材表面にポリフルオロ基を含有しないシラン化合物、または合成樹脂材料の塗膜を形成し、その上にポリフルオロ基を含有するシラン化合物からなる撥水撥油多層膜を形成することが開示されている。

上記特公平4-20781号公報に開示される方法で得られる基材にあっては 、下地膜の緻密性が低く、そのため下地膜の厚みを100 n m以上にしなければ ならず、焼成温度も400℃以上にしなければならない。

また、特開平5-86353号公報には、ガラス、金属、セラミックス、プラスチックなどの基材表面に、SiCl₄などのクロロシリル基を分子内に含む化合物を用いてシロキサン系薄膜を形成し、その上に化学吸着単分子累積膜(撥水膜)を形成する方法が記載されている。

上記特開平5-86353号公報に開示される方法にあっては、吸着用処理剤が空気中の水と反応して不安定であるので、雰囲気の湿度を低く維持する必要があり、環境条件の管理が難しい。また、処理時間に2~3時間を要し、非水系溶媒が高価であるなどの問題がある。

また、特開平5-161844号公報には、基材表面に予めシロキサン系単分 子膜またはポリシロキサンの吸着膜を形成しておき、更にクロロシラン系界面活 性剤を含む雰囲気で化学吸着を行うことにより、基材表面に化学吸着単分子膜(撥水膜)を形成する方法が記載されている。

上記特開平5-161844号公報に開示される方法を実施するには、雰囲気制御のための装備が大がかりとなり、完全な吸着膜形成には時間を要する。

また、特開平2-311332号公報には、表面に金属酸化物、例えばSiO2が形成されたガラス基材の表面をシリル化合物、例えばフッ化アルキルシランでシリル化した撥水ガラスが記載されている。

上記特開平2-311332号公報に開示される方法で得られる基材にあっては、金属酸化物をゾルゲル法で成膜する場合、例えば500℃での焼成により金属酸化膜を緻密化する必要があので、高温焼成を行うための大掛りな設備が必要となり、製作コストが嵩む。またこの方法を追試したところ、得られる金属酸化膜の表面粗さが比較的粗いため、撥水性ガラス表面に付着した水滴が転がりにくいという結果が得られた。

更に、特許第2,525,536号公報には、特開平2-311332号公報に記載されたのと同様の構成、即ち、フッ素化合物でガラス基体の表面を処理する前に、ガラス基体にシリカ下地膜を適用することが開示され、更に、フッ素化合物にオレフィンテロマーを含有させることにより、撥水膜の耐候性を改善することが開示されている。

上記特許第2,525,536号公報に開示される方法で得られる基材にあっては、耐候性には優れているが、追試したところ、摩擦試験での撥水膜の耐久性が不十分で、またシリカ下地膜の表面粗さ力が比較的粗いため、撥水性ガラス表面に付着した水滴が転がりにくいという結果が得られた。

発明の開示

本発明は、上述の従来の技術が有する問題点を解消すべくなされたものでり、下地膜を介して、基材と撥水膜とが強固に結びつき、しかも、低い臨界

傾斜角、優れた耐久性を有し、緻密性が高い基材を得ることを目的とする。

この目的を達成するため、本発明に係る表而処理された基材は、ガラス、セラミックス、プラスチック或いは金属等の基材表面に、クロロシリル基を分子内に有する物質をアルコール系溶媒に溶解して反応させた下地処理液を乾燥せしめて

なる下地膜が形成され、この下地膜の上に撥水層または撥油層等の表面層が形成され、且つ表面粗さ(Ra)が0.5 nm以下とした。

尚、表面層の表面粗さ(Ra)は出来るだけ小さいことが好ましい。但し、例えばフロートガラスの火造り面の表面粗さ(Ra)は0.2nm程度であり、精密研磨されたガラス表面の表面粗さ(Ra)は0.1nm程度であるので、実質的に得られる表面層の表面粗さ(Ra)の下限値は $0.1\sim0.2nm$ 程度である。

上記したように、クロロシリル基を分子内に有する物質をアルコール系溶媒に溶解して反応させた下地膜は平滑性が高くなり、この下地膜の上に形成される表面層は下地膜の平滑性を反映して平滑性が高く($Ra \le 0$. 5 nm)なり、優れた撥水性能、つまり高接触角、低臨界傾斜角を得ることが可能になる。

ここで、基材表面に下地膜を形成するにあたり、基材表面を清浄にすることで外観欠点をなくすとともに、基材表面を活性化することで基材表面と下地膜との接着強度を高めることができる。例えば、酸化物であるガラス板の場合でも研磨剤によって表面を $0.5nm \le Ra \le 3.0nm$ 程度に研磨することで活性な表面を形成することができる。

尚、基材表面のRaが3. 0 n mを超えると、下地処理を施しても表面層(撥水層)のRaが0. 5 n m以下になりにくいので、基材表面のRaは3. 0 n m以下とするのが好ましい。因みに、基材をガラス板とした場合には、基材表面のRaが0. 5 n m $\leq Ra \leq 3$. 0 n mの範囲では透明性を維持している。

また、基材の表面に親水性基が少ない場合には、その表面を、予め酸素を含むプラズマまたはコロナ雰囲気で処理して親水性化したり、あるいは、基材表面を酸素を含む雰囲気中で200~300nm付近の波長の紫外線を照

射して、親水性化処理を行った後に、表面処理を行うことが好ましい。

また、クロロシリル基を分子内に有する物質の下地処理液中の濃度としては、0.01wt%以上3wt%以下とするのが適当である。

クロロシリル基を分子内に有する物質としては、SiCl4、SiHCl3 またはSiH2 Cl2 が挙げられ、これらの中から、単独または複数の物質を選ぶことができる。好ましくはSiCl4がCl基が多く含まれているので好ましい。クロロシリル基は反応性

が非常に高く、自己縮合または基材表面と縮合反応をすることにより緻密な下地膜を形成する。尚、水素基の一部がメチル基やエチル基に置換された物質を含んでもよい。

またアルコール系溶媒としては、例えば、メタノール、エタノール、1ープロパノール、2ープロパノールなどが好ましい。クロロシリル基を分子内に有する物質とアルコール系溶媒とは、式(1)に示すように、脱塩化水素によりアルコキシドを形成する。

$$(-Si-C1) + (ROH) \rightarrow (-Si-OR) + (HC1) \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$$

また、クロロシリル基を分子内に有する物質とアルコール系溶媒とは、式(2)に示すようにも反応する。

$$(-Si-C1) + (ROH) \rightarrow (-Si-OH) + (RC1) \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$

アルコール溶媒中で、式(1)により生成した酸触媒により(-Si-OR)の一部は更に以下の式(3)のように反応して、(-Si-OH)を生成する。

$$(-Si-OR) + (H_2 0) \rightarrow (-Si-OH) + (ROH) \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$$

そして、式(2)及び式(3)で生成された(-Si-OH)は式(4)のように 反応してシロキサン結合を形成する。

$$(-Si-C1) + (-Si-OH) \rightarrow (-Si-O-Si-) + (HC1)$$

$$\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (4)$$

上記のシロキサン結合(-Si-O-Si-)によって、基材と下地膜、また下地膜と撥水膜などの表面膜との間の結合が強固になされると考えられる。即ち、従来のように単純にシロキサン結合を有する化合物を下地処理液とした場合には、下地膜中にシロキサン結合は存在するが、基材と下地膜、また下地膜と撥水膜とをつなぐシロキサン結合はそれほど多くならない。

本発明のように、クロロシリル基を分子内に有する物質とアルコール系溶媒と が調合直後から30分以内に反応した下地処理液にて処理することで、平滑性の よい下地膜が形成され、またクロロシリル基の一部がシロキサン結合になり、こ のシロキサン結合によって基材と撥水膜との間の仲立が行なわれる。

ここで、クロロシリル基を分子内に有する物質の濃度は、塗布方法にもよるが

0.01wt%~3wt%程度が適当である。これより濃度が低いと、当該物質の添加効果がなく、またこれより濃度が高くても下地処理の効果は、変わらない。例えば、フローコートで塗布する場合には塗布時の外観上からは0.03wt%~1.0wt%程度がさらに好ましい。

また、下地処理液の塗布方法は、特に限定されるものではないが、例えばディップコート、フローコート、スピンコート、バーコート、ロールコート、手塗り法、刷毛塗り法、スプレー塗布などが挙げられる。

また、表面処理としては、例えば、撥水・撥油処理が挙げられる。撥水・撥油 処理の液剤としては、特に限定されないが、シラン化合物、シロキサン化合物、 シリコーン化合物を含有する撥水・撥油剤を用いて処理する方法が好ましい。

シラン化合物の例としては、CF₃ (CF₂)₇ (CH₂)₂ Si (OCH₃)₃、CF₃ (CF₂)₆ (CH₂)₂ Si (OCH₃)₃、CF₃ (CF₂)₇ (CH₂)₂ Si Cl₃、CF₃ (CF₂)₆ (CH₂)₂ Si Cl₃、などを含有する撥水剤が挙げられる。

これらの撥水剤は必要に応じて、酸、塩基などの触媒を用いて加水分解して用いてもよい。またシラン化合物を加水分解、縮合反応させてシロキサン化合物として用いたものでもよい。

シリコーン化合物としては直鎖、または鎖状のポリジメチルシロキサン、またはそのシラノール変成、アルコキシド変成、ハイドロジエン変成、ハロゲン変成などを用いることができる。

撥水・撥油処理の方法としては、下地処理の場合と同様に、特に限定されないが、手塗り法、刷手塗り法などが挙げられる。

また、本発明の表面処理としては、撥水・撥油処理の他に、親水処理、防

曇処理などが挙げられる。

図面の簡単な説明

なし

発明を実施するための最良の形態

(実施例1)

エタノール(ナカライテスク製)100gにクロロシラン(SiCl4、信越シリ

コーン製) 0.01gを撹拌しながら添加し、下地処理液を得た。この下地処理液を研磨洗浄したガラス基板(300×300mm)上に、湿度40%、室温下でフローコートにて塗布し、約1分で乾燥し、下地処理被膜を得た。

次いで、 CF_3 (CF_2) $_7$ (CH_2) $_2$ Si(OCH_3) $_3$ (ヘプタデカフルオロデシルトリメトキシシラン、東芝シリコーン製) 1.3 gをエタノール 4 0.6 g に溶解し、1時間撹拌を行った後、イオン交換水 0.8 g および 0.1 N 塩酸を 1.0 g添加し、更に 1 時間撹拌し、撥水処理剤 a を得た。

この後、綿布に3mlの撥水処理剤aをつけ、下地処理被膜のついたガラス基板に塗り込んだ後、過剰に付着した撥水処理剤をエタノールを含ませた新しい綿布で拭き取り、撥水処理ガラスを得た。

水の接触角を、接触角計 (CA-DT、協和界面科学製)を用いて、水滴 2 mg 静的接触角として測定した。

耐候性試験としてアイスーパーUVテスター(W-13、岩崎電気製)を用いて、紫外線強度 $76\pm2\,\mathrm{mW/c\,m}^2$ とし、ブラックパネル温度 $48\pm2\,\mathrm{C}$ 、照射 20 時間、暗黒 4 時間のサイクルで、1 時間毎に30 秒間イオン交換水シャワーリングをする条件で400 時間紫外線を照射した。

また、摩擦試験として、砂消しゴム(ライオン製 No. 502)を 15×7 mmの面積に50gの荷重にて、撥水処理ガラス上を100回往復活動させた。

更に、撥水性能を示す尺度として、臨界傾斜角を測定した。水滴が撥水性

ガラス(接触角= $100\sim110^\circ$)の表面を転がる性能を測定するため、水平に配置した撥水性ガラス板表面に直径 $5\,\mathrm{mm}$ (接触角が $100\sim110^\circ$ であれば水滴はほぼ半球形になる)の水滴を置き、徐々に撥水性ガラス板を傾斜させて、表面に置いた水滴が転がり始める時のガラス板の傾斜角(臨界傾斜角)を測定した。臨界傾斜角が小さいほど、動的な撥水性が優れており、例えば走行中の自動車のガラス窓に付着した雨滴が飛散しやすくなって、運転者の視野が妨げられないことになる。

尚、得られた撥水性ガラスの平滑性は、原子間力顕微鏡(SPI370、セイコー電子(株)製)を用いて、サイクリックコンタクトモードにて、表面形状を

測定し、表面粗さ(Ra)を算出した。

(表1)に示すように、初期接触角は108°、初期臨界傾斜角は13°、耐候性試験400時間後の接触角は88°、摩擦試験結果後の接触角は84°の耐久性能を示した。

(比較例1)

下地処理液の調合でクロロシランを 0.005g(0.005wt%)添加した 以外は、実施例 1 と同様にして撥水処理ガラスを得た。

(表1)に示すように初期接触角は107°を示したが、初期臨界傾斜角は18°と大きく、耐候性試験後の接触角は71°まで低下し、耐久性能が低下していることが示された。

(実施例2乃至実施例4及び比較例2)

下地処理液の調合でクロロシランを 0.5、1.0、3.0、5.0g(濃度は各々 0.5、1.0、3.0、5.0wt%)添加した以外は、実施例 1 と同様にして撥水処理ガラスを得た。

クロロシラン濃度が高くなると、下地膜の厚みが厚くなり、その結果、光の干渉が徐々に強くなり、濃度が5wt%を超えると、反射色が特に目立つようになった。更にクロロシラン濃度を高め下地膜の厚みが厚くなると、焼成工程も必要になる。

(実施例5)

温度計、撹拌機、冷却器を備えた1リットルガラス反応器に、CF3 (CF

 2) $_7$ (CH $_2$) $_2$ Si(OCH $_3$) $_3$ (ヘプタデカフルオロデシルトリメトキシシラン、東芝シリコーン製) 1 O. O g に下記化学式(数 1)で示される加水分解性基含有ポリジメチルシロキサン 1 O. O g を t ーブタノール 3 6 O g、及び O. 1 N塩酸 1. 9 4 g を仕込み、 8 O $\mathbb C$ で 5 時間共加水分解反応させ、さらに疎水性溶媒である n ーヘキサン 1 6 O 重量部を加えて、室温で 1 O 時間撹拌した。

「数 1]

さらに下記化学式(数 2)で示されるオルガノポリシロキサン 1 0 . 0 g およびメタンスルホン酸 5 . 0 g を加え、1 0 分間撹拌し撥水処理剤 b を得た。 「数 2]

撥水処理剤を、実施例1と同様の方法で、SiCl4濃度を0.5wt%として作製した下地処理ガラス基板に塗布し、撥水性ガラスを得た。

この撥水性ガラスでも、表1に示すように初期接触角、耐久性能(耐候性試験、摩擦試験)に優れた結果が得られた。

(比較例3及び比較例4)

下地処理剤としてクロロシランの替わりにテトラクロロスズ、テトラクロロジルコニウムを用いて、下地処理を行った後に、撥水処理剤 b を用いて撥水性ガラスを作製した。

初期接触角は106°を示したが、初期臨界傾斜角は18°および19°と大きくなり、耐候性試験後の接触角は65°及びと64°に低下した。

(比較例5)

下地処理液の溶媒としてエタノールの替わりにクロロホルムを用いた以外は、 実施例1と同様に作製して撥水性ガラスを得た。

初期接触角は107°を示したが、初期臨界傾斜角は20°と大きく、耐候性 試験後の接触角は63°に低下し、摩擦試験後の接触角は67°に低下した。

(比較例 6)

この比較例 6 は先行技術として挙げた特許第 2 5 2 5 5 3 6 号の実施例 6 の下地 A を追試したものである。

即ち、下地処理液の溶媒としてエタノールの代わりにペルフルオロカーボン溶液 (FC-77、3M社製)を用いた以外は、実施例1と同様にして撥水性ガラスを得た。

表面粗さRaは7.0 n m と高い値を示し、初期臨界傾斜角も25°と高かった。初期接触角は107°を示したが、摩擦試験後の接触角は65°と低下した。 (比較例7)

この比較例 7 は先行技術として挙げた特開平 2 -311322 号の実施例 3 を 追試したものである。

即ち、テトラエチルシリケート(コルコート社製) 31gをエタノール 380g に溶解・撹拌し、水 6.5g、1N 塩酸 1.6g を添加・撹拌し、20 ℃にて 24 時間撹拌して、下地処理液を調製した。

この下地処理液を実施例 1 と同様にフローコートにて塗布し、約 1 分間で乾燥した。この下地処理後、500 ℃、1 時間熱処理することによりシリコン酸化物層を形成した。この後、実施例 1 と同様に撥水処理剤 a にて撥水処理ガラスを得た。

表面粗さRaはO.6 n m と高い値を示し、初期臨界傾斜角も22°と高かった。初期接触角は107°を示したが、摩擦試験後の接触角は67°と低下した。 (比較例8)

下地膜の熱処理を行わずに作製した以外は比較例7と同様にして撥水処理ガラスを得た。

表面粗さRaは O. 7 n m と高い値を示し、初期臨界傾斜角も 2 3°と高かった。初期接触角は 1 O 8°を示したが、摩擦試験後の接触角は 4 5°まで低下した

以上の実施例及び比較例の結果を以下の(表1)にまとめた。 「表1]

摩擦試験	(100回後)	角。)	84	65	82	87	87	84	86	8	83	67	ල් වි	67	45
摩梅	200	の接触角(。	ω	9	ω,	. 00	ω,	- α	€		œ.	ф 	9	Φ	4
耐候性試験) (400時間後)	の接触角(゜)	82	71	98	87	98	87	88	92	64	63	09	54	20
初期臨界	傾斜角(゜)		13	,	12	12	<u></u>	12	. 12	82	19	20	25	22	23
初期接触角	<u>ິ</u>		108	107	107	108	109	107	108	106	106	107	107	107	108
表面相さ	Ra(nm)		0.4	0.9	0.2	0.3	0.5	0.3	0.2	0.7	0.6	9.0	7.0	0.7	0.7
, ,	外觀		Ş	S X	Š	충	ş	反射色目立つ	Š	ş	Š	ò	S S	Š	숭
蒸头	処理剤		撥水剤a	整水剤a	极大绝3	极大知3	藏 大傑a	梭水剤a	撒 大部	数 大 等	数水部	椒大色"	馥水剤a	藏 大館a	梭水剤a
下地処理原料	/譲废(wt%)		SiCh/0.01	SiCl4/0.005	SiCl4/0.5	SiCl4/1.0	SiCl4/3.0	SiCl4/5.0	SiCl4/0.5	SnCl₄/1.0	ZrCl4/1.0	SiCl4/1.0 *1	SiCl4/1.0 *2	TE0S/0.4	TE0S/0.4
			実施例1	比較例1	実施例2	実施例3	実施例4	比較例2	実施例5	比較例3	比較例4	比較例5	比較例6	比較例7	比較例8

*1溶媒:クロロホルム *2溶媒:ペルフルオロカーボン

RaはJIS B 0601-1982に準拠して測定した。

産業上の利用可能性

[表1]

本発明に係る表面処理された基材は、撥水性を発揮する自動車用のウインドシ ールド等として利用される。

【国際調查報告】

	INTERNATIONAL SEARCH	REPORT	Listen and Ame	Cartan Ma
		Min OKI	PCT/JP 98	fleation No /01001
A CLASSIS	ICATOM OF SUBJECT HATTED		101/01 30	701001
ÎPC 6	C03C17/42 C09K3/18			
	International Patent Classification (IPC) or to both national class	ification and IPC		
3. FIELDS 9	SEARCHED cumentation searched (classification system followed by classific	ration aumbodat		
IPC 6	C03C C09K	2.11011 (3.11.12.010)		
Documentation	on searched other than minimum documentation to the extent the	at such documents are i	ncluded in the fields sea	arched
Electronic da	ta base consulted during the international search (name of data	base and, where practi	cal, search tenns used)	
C. DOCUME	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages		Relevant to claim No.
Y	EP 0 545 201 A (PPG INDUSTRIES 1993 cited in the application see page 4, line 14 see page 5, line 3 - line 4 see page 6, line 23 - line 26 see page 6, line 55 - line 57 see page 7, line 37 see page 8, line 14 - line 16 see page 8, line 48 - line 50 see page 9, line 23 - line 26 see page 9, line 47 - line 48 see page 10, line 15 - line 20 see page 10, line 49 - line 50 see page 11, line 21 see examples 1,2,5,6,8-12 å JP 02 525 536 B	-/		1-6
X Funth	er documents are listed in the continuation of box C.	X Patent fan	ily members are listed	in annex.
"A" documer consider	nt which may throw doubte on priority doim(e) or cried to establish the publication day of another or other special reason (as specified) Intralerring to an oral disclosure, use, exhibition or neano In published prior to the international fläng date but an the priority date claimed	ur pilority date onte to under invention "X" document of py connot be con involve an inv "Y" document of py connot be con document is con document is con ments, such o in the att. "&" document ments.	articular relevance; the sidered to involve an in ombined with one or mombination being obviouser of the earns patent	the application but every underlying the clearned invention of the considered to counsel is taken alone clearned in taken alone clearned invention also when the ore other auch docurrence to the country of the country of the terminal of the country of the countr
	ctual completion of the international search		of the international se	aron report
	5 June 1998		/1998	
vame and m	naling address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlean 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tell. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized offi		

Form PCT//SA/210 (second sheet) (July 1992)

Inter. ortal Application No PCT/JP 98/01001

		PCT/JP 98/01001			
	on) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category *	Station of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
Y	EP 0 484 746 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND COLTD) 13 May 1992 cited in the application see page 3, line 51 - page 4, line 12 see page 4, line 36 - line 37 see page 6, line 49 see page 8, line 36 see page 12, line 13 see page 12, line 13 see page 13, line 19 see page 13, line 54 see examples & JP 05 086 353 A	1-6			
Y	WO 96 06895 A (XAAR LTD ;GRIFFIN MARY CATHERINE AMBROSE (GB); HOWARTH LESLIE GEOR) 7 March 1996 see examples 1,9-11	1-6			
A	US 5 550 184 A (HALLING ROBERT A) 27 August 1996 see column 1, line 6 - line 15 see column 2, line 29 - column 3, line 6 see column 3, line 59 - column 4, line 42 see column 5, line 19 - column 6, line 6 see column 6, line 24 - line 55 see example 4	1-6			
A	US 5 552 476 A (HALLING ROBERT A) 3 September 1996 see column 1, line 12 - line 20 see column 3, line 47 - column 4, line 8 see column 5, line 5 - line 7 see column 1, line 66 - column 2, line 16	1-6			
A	US 5 459 198 A (SHARP KENNETH 6) 17 October 1995 see column 1, line 9 - line 11 see column 2, line 32 - line 47 see column 7, line 9 - line 41	1-6			
A	EP 0 547 550 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND COLTD) 23 June 1993 cited in the application see page 6, line 42 - line 53 see examples & JP 05 161 844 A	1-6			
	EP 0 547 550 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 23 June 1993 cited in the application see page 6, line 42 - line 53 see examples & JP 05 161 844 A	1			

form PCT/ISA/210 (construction of second sheet) (July 1992)

Intern. Snel Application No PCT/JP 98/01001

		PCT/JP 98/01001						
<u> </u>	Constitueation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEYANT GOOD * Citation of document, with indication where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.							
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.						
A	DATABASE WPI Section Ch, Week 9218 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A82, AN 85-090552 XP002069396 & JP 04 020 781 B (ASAHI GLASS CO LTD) cited in the application see abstract	1-6						
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 015, no. 100 (C-0813), 11 March 1991 & JP 02 311332 A (SEKISUI CHEM CO LTD), 26 December 1990, cited in the application see abstract see line 1	1-6						
m PCTfeA	210 (continuation of secong sheet) (July 1992)							

Information on patent family members

Inter. onal Application No PCT/JP 98/01001

EP	terit document In search report 0545201		Publication date		Patent family	Publication
	0545201				member(s)	date
		A	09-06-1993	US CA JP	5328768 A 2082094 A,C 2525536 B	12-07-1994 30-05-1993 21-08-1996
EP				JP	5238781 A	17~09-1993
L-1	0484746	A	13-05-1992	JP	2052440 C	10-05-1996
				JP JP	4252235 A 7091402 B	08-09-1992 04-10-1995
				JP	2501248 B	29-05-1996
				JP	4239635 A	27-08-1992
				JP	2093588 C 4240171 A	18-09-1996 27-08-1992
				JP JP	8009510 B	31-01-1996
				ĴΡ	4256710 A	11-09-1992
				JP	7098026 B	25~10~1995
				CA DE	2054094 A 69122212 D	26-04-1992 24-10-1996
				DE	69122212 T	30-01-1997
				KR	9504153 B	27-04-1995
				US	5380585 A	10-01-1995 14-11-1995
				US JP	5466486 A 5086353 A	06~04-1993
				DE	69120788 D	14-08-1996
				DE	69120788 T	07-11-1996 08-07-1992
				EP Jp	0493747 A 5070761 A	23-03-1993
				KR	9615626 B	18-11-1996
				US	5407709 A	18-04-1995 08-02-1994
				US	5284707 A	
WO	9606895	A	07-03-1996	CA EP	2198720 A 0778869 A	07-03-1996 18-06-1997
บร	5550184	A	27-08-1996	AU	1937695 A 0748323 A	18-09-1995 18-12-1996
				EP Jp	9509939 T	07-10-1997
				WO	9523804 A	08-09-1995
				US	5552476 A	03-09-1996
US	5552476	Α	03-09-1996	US	5550184 A	27-08-1996

Information on patent family members

PCT/JP 98/01001

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date	
US	5552476	A		AU EP JP WO	1937695 A 0748323 A 9509939 T 9523804 A	18-09-1995 18-12-1996 07-10-1997 08-09-1995
US	5459198	A	17–10–1995	AU CA EP JP WO	2967995 A 2192551 A 0772644 A 10503795 T 9604331 A	04-03-1996 15-02-1996 14-05-1997 07-04-1998 15-02-1996
EP	0547550	A	23-06-1993	JP JP JP DE KR US	2603017 B 5161844 A 5168913 A 69224888 D 9701519 B 5372851 A	23-04-1997 29-06-1993 02-07-1993 30-04-1998 11-02-1997 13-12-1994

Form PCT/ISA/210 (patent family ennes) (July 1992)

フロントページの続き

(81)指定国 EP(AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, L U, MC, NL, PT, SE), OA(BF, BJ, CF , CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AP(GH, GM, KE, LS, M W, SD, SZ, UG, ZW), EA(AM, AZ, BY , KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), AL, AM , AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, E S, FI, GB, GE, GH, HU, IL, IS, JP , KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, M X, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE , SG, SI, SK, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, UZ, VN, YU (72) 発明者 砂田 貴

> 大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号 日本板硝子株式会社内

(72)発明者 神谷 和孝 大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号 日本板硝子株式会社内